

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-003 金屬濺鍍系統)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 1 / 3 頁

一、目的：

定義金屬濺鍍系統操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用於金屬濺鍍系統。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過金屬濺鍍系統考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

無。

六、標準作業程序：

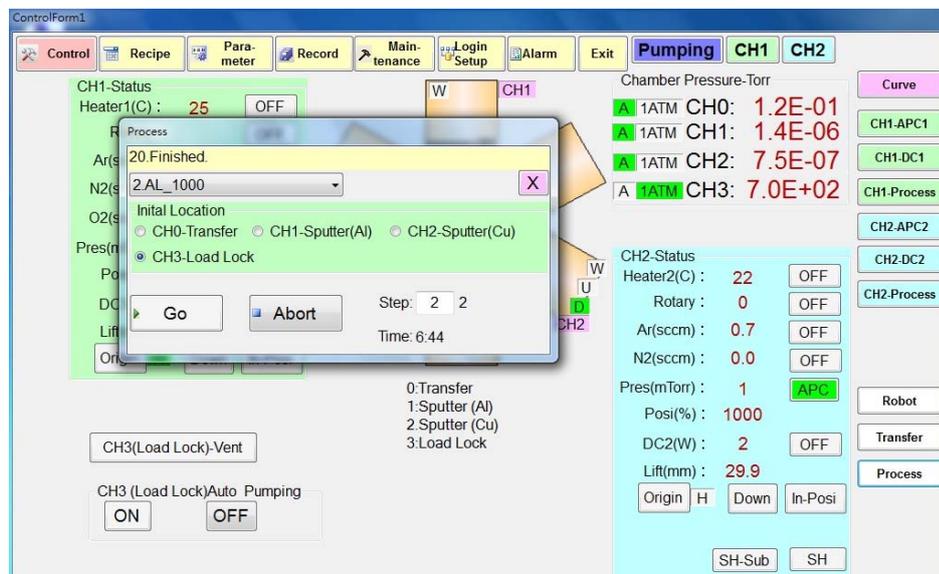
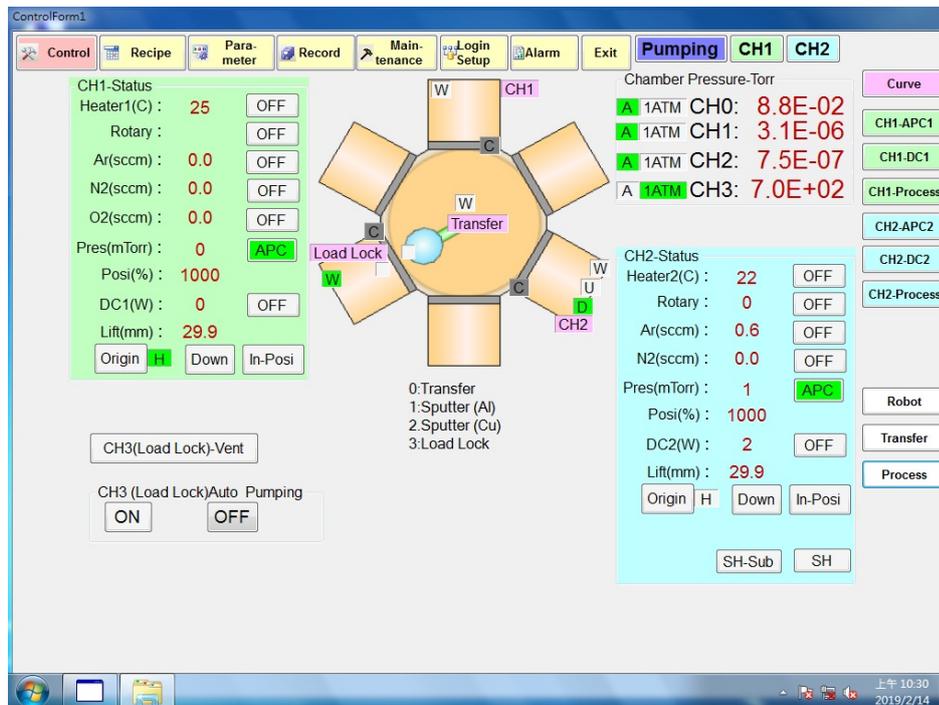
1. 執行使用前檢查項目，檢查完畢後登入開機：
 - 1-1. 總電源、機械手臂及製程監控電腦是否開啟。
 - 1-2. 冷凍幫浦溫度是否正常（幫浦溫度應顯示為 10.0 +/- 5 K），如下圖所示。



- 1-3. Rotary pump 是否運轉正常。
 - 1-4. 功率產生器是否開啟。
 - 1-5. 機械手臂是否位於正常位置（位於 Transfer chamber 正中間）。
 - 1-6. 登入後即開啟監控電腦螢幕。
2. 系統主要操作畫面如下圖，點選左下角 **CH3(Load Lock)-Vent**，CH3 破真空，將試片置放於載台上，闔上 CH3 上蓋。

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-003 金屬濺鍍系統)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 2 / 3 頁

- 點選右下角 **Process**，選取濺鍍薄膜材料及厚度，執行 **Go**。
- 濺鍍完成，取出試片，點選 **CH3(Load Lock)Auto pumping**



- 登出關閉電腦螢幕。

NAR Labs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心		DOCUMENT NO. : Q3-NL04	TITLE : 設備作業標準 (SE-003 金屬濺鍍系統)		
ISSUE DATE	2019-02-22	REVISION	1.0	PAGE	第 3 / 3 頁

注意事項：

1. 放置六、八吋晶圓均必須使用載台。
2. 沈積玻璃載玻片時，最多只限放置 1 片在載台上，以免造成手臂負荷過重而造成手臂變形故障。
3. 功率設定嚴禁超過 1000 W。
4. 上述注意事項缺一不可

七、應用表單及附件：

1. Q4-NL02 設備管理卡
2. Q4-NL03 設備考核表
3. Q4-NL04 設備點檢表
4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單